MENUS SEARCH INDEX DETAIL JAPANESE BACK

3/3

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-053755

(43)Date of publication of application: 26.02.1999

(51)Int.CI.

G11B 7/135 G11B 7/00

G11B 7/09 G11B 7/125

G11B 19/12

(21)Application number: 09-206656

(71)Applicant : RICOH CO LTD

(22)Date of filing: 31.07.1997

(72)Inventor: AKIYAMA HIROSHI

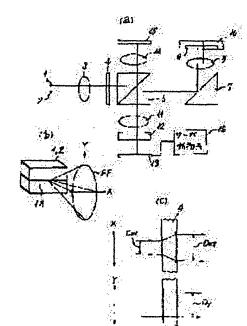
TAKAHASHI YOSHITAKA

## (54) OPTICAL PICKUP DEVICE

## (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a compact optical pickup device capable of performing recording/reproducing for two different kinds of optical recording media having different recording/reproducing wavelengths and performing good beam shaping.

SOLUTION: This optical pickup device comprises first and second light sources 1 and 2 having different emitted light wavelengths, a coupling lens 3 for coupling luminous fluxes from the light sources, an objective lens 8 for converting the coupled luminous fluxes on the optical recording surfaces of optical recording media 9 and 10, an optical path separation optical means 5 for separating returning lights reflected by the optical recording media from irradiation paths, detecting means 11, 12 and 13 for receiving the luminous fluxes and detecting the information of the reflected luminous fluxes and a control means 16



for performing focusing control and tracking control based on the detecting results of the detecting means. The device further comprises a beam shaping hologram element 4 for converting the elliptic intensity distributions of the luminous fluxes from the first and second light sources into intensity distributions close to circle, and the light source 1 is lit only when the optical recording medium 10 is used, and the light source 2 is lit only when the optical recording medium 9 is used.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

16.04.2002

Date of sending the examiner's decision of

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

## 特開平11-53755

(43)公開日 平成11年(1999) 2月26日

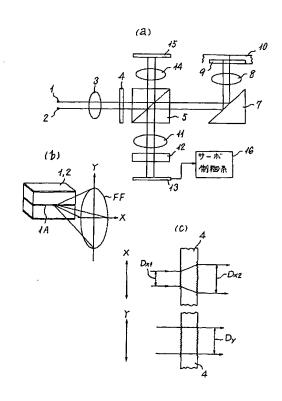
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	FI					
G11B	7/135	•		7/135 A				
	7/00			7/00	Q D B			
	7/09			7/09				
	7/125			7/125				
	19/12	5 0 1	1	19/12 5 0 1 N				
			審查請求	未請求	請求項の数17	OL	(全 13 頁)	
(21)出願番号	<b></b>	特願平9-206656	(71) 出願人	出願人 000006747				
				株式会社	株式会社リコー			
(22)出願日		成9年(1997)7月31日 東京都大田区中馬込1丁目3番				⊧6号		
			(72)発明者	(72)発明者 秋山 洋				
				東京都大	大田区中馬込1丁	1目3番	6号・株式	
				会社リニ	7一内			
			(72)発明者	高橋 彰	孝			
				東京都大	、田区中馬込1丁	目3番	6号・株式	
				会社リニ	1一内			
			(74)代理人	弁理士	樺山 亨 (外	1名)		

## (54) 【発明の名称】 光ピックアップ装置

## (57) 【要約】 (修正有)

【課題】記録再生波長の異なる2種の光記録媒体に対して記録再生を行うことができ、良好なビーム整形とコンパクト化の可能な光ピックアップ装置。

【解決手段】発光波長の異なる第1、第2の光源1,2 と、各光源からの光東をカップリングするカップリング レンズ3と、カップリングされた各光東を光記録媒体 9,10の光記録面に集光させる対物レンズ8と、光記 録媒体により反射された戻り光東を照射光路から分離さ せる光路分離光学手段5と、該光東を受光して反射光東 の情報を検出する検出手段11,12,13と、検出手 段の検出結果に基づき、フォーカシング制御およびトラ ッキング制御を行う制御手段16と、第1、第2の光源 からの各光東に対し、その楕円強度分布をより円形に近 い強度分布に変換するビーム整形用ホログラム素子4を 有し、光源1は光記録媒体10のときにのみ光源2は光 記録媒体9のときにのみ点灯される。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】記録・再生の波長が互いに異なる第1種および第2種の光記録媒体の何れにも使用可能な光ピックアップ装置であって、

互いに発光波長の異なる第1および第2の光源LDと、これら第1および第2の光源LDに共通に設けられ、各 光源LDからの光束をカップリングするカップリングレ ンズと、

カップリングされた各光束を、光記録媒体の光記録面に 光スポットとして集光させる、上記各光束に共通の対物 レンズと、

上記光記録媒体により反射され、上記対物レンズを介して戻り光束となった各光束を、上記光源LDから対物レンズに至る照射光路から分離させる、上記各光束に共通の光路分離光学手段と、

該光路分離光学手段により分離された各光束を受光して、反射光束の情報を検出する、上記各光束に共通の検出手段と、

該検出手段の検出結果に基づき、フォーカシング制御およびトラッキング制御を行う制御手段と、

・上記第1および/または第2の光源LDからの光束に対し、その楕円強度分布をより円形に近い強度分布に変換するビーム整形用ホログラム素子を有し、

上記第1の光源LDは、上記第1種の光記録媒体が用いられるときにのみ点灯され、第2の光源LDは、上記第2種の光記録媒体が用いられるときにのみ点灯されることを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項2】請求項1記載の光ピックアップ装置におい で

ビーム整形用ホログラム素子が、偏光性ホログラムであることを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項3】請求項1または2記載の光ピックアップ装置において、

第1および第2の光源LDからの各光束に対し、所定の 位相差を発生させる位相子を有することを特徴とする光 ピックアップ装置。

【請求項4】請求項3記載の光ピックアップ装置において、

ビーム整形用ホログラム素子が偏光性ホログラムであり、該偏光性ホログラムが位相子と一体化されていることを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項5】請求項3または4記載の光ピックアップ装置において、

位相子は、一方の光源LDからの光束に対して波長の半整数倍の位相差を生じさせ、他方の光源LDからの光束に対して波長の整数倍の位相差を生じさせるものであることを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項6】請求項1~5の任意の1に記載の光ピックアップ装置において、

光路分離光学手段が光路分離用ホログラム素子であるこ

とを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項7】請求項6記載の光ピックアップ装置において、

光路分離用ホログラム素子が偏光性ホログラムであることを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項8】請求項7記載の光ピックアップ装置において、

第1および第2の光源LDからの各光束に対し、所定の 位相差を発生させる位相子を複数有することを特徴とす る光ピックアップ装置。

【請求項9】請求項8記載の光ピックアップ装置において、

ビーム整形用ホログラム素子と光路分離用ホログラム素子がともに、偏光性ホログラムであって、複数の位相子と、上記各偏光性ホログラムが一体化されていることを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項10】請求項3または4または5または8または9記載の光ピックアップ装置において、

位相子が、蒸着位相差膜であることを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項11】請求項1~10の任意の1に記載の光ピックアップ装置において、

第1および第2の光源LDを同一キャン内に配備したことを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項12】請求項11記載の光ピックアップ装置において、

第1および第2の光源LDを配備した同一キャン内に、 検出手段の受光部が配備されていることを特徴とする光 ピックアップ装置。

【請求項13】請求項1~12の任意の1に記載の光ピックアップ装置において、

カップリングレンズは、第1および第2の光源LDからの光束をコリメートする機能を有し、ホログラム素子が、各光源LDからの光束が平行光束となる部分に配備されることを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項14】請求項1~12の任意の1に記載の光ピックアップ装置において、

ホログラム素子が、第1および第2の光源LDからカップリングレンズに至る光路上に配備されることを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項15】請求項14記載の光ピックアップ装置に おいて、

第1および第2の光源LDを同一キャン内に配備し、且 つホログラム素子を上記キャンに一体化したことを特徴 とする光ピックアップ装置。

【請求項16】請求項1~15の任意の1に記載の光ピックアップ装置において、

第1の光源LDからの光束の光軸と、第2の光源LDからの光束の光軸とを、各光束のファーフィールドパターンの方向を揃えて、カップリングレンズに対して互いに

合致させる光軸合わせ光学手段を有することを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項17】請求項16記載の光ピックアップ装置に おいて、

第1および第2の光源LDを同一キャン内に配備し、上記キャン内に光軸合わせ光学手段を配備したことを特徴とする光ピックアップ装置。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】この発明は光ピックアップ装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】近来、光ディスクに代表される光記録媒体は、記録容量の大容量化が強く要請されている。光記録媒体自体を大型化することなく記録容量を増大させるためには、情報の記録・再生に置ける光スポット径を小径化する必要がある。光スポット径は、光波長:んに比例するから、記録容量は光波長:んの2乗に逆比例することになる。このため、光ピックアップ装置に用いられる光源波長の短波長化が追求され、波長:785nmで記録・再生を行う従来の光ディスク(CD-R)に対して、光源波長:650nmで記録・再生を行う光ディスク(DVD)が実現している。

【0003】このような記録・再生の波長が互いに異なる異種の光記録媒体の何れにも使用可能な光ピックアップ装置として、発光波長の異なる2種の半導体レーザ(この明細書中において光源LDと略記する)を光源として有する光ピックアップ装置が提案されている(特開平6-259804号公報)。

【0004】ところで、良く知られたように、光源LDから放射される光束は発散性で、その発散角は一様でなく、ファーフィールドパターンは楕円形状である。

【0005】光記録媒体上に集光させる光スポットは「円形状」であることが好ましく、光スポットが「楕円形状」になるほど、記録・再生能力が低下する傾向がある。円形状の光スポットを得るには、カップリングレンズで光源LDからの光束をカップリングする際、ファーフィールドパターンの長軸方向の一部を遮光して円形の光束断面を得るようにすればよいが、この方法では「光源からの光束の少なからざる部分が光記録媒体に対して遮断されてしまう」ので、記録・再生に供される光エネルギの利用効率が悪い。光ピックアップ装置で光記録媒体に情報記録を行う場合には、情報再生の10倍以上の光エネルギが必要であり、この目的のためには、光源LDからの光束のより多くの部分を光スポット形成に取り込む必要がある。

【0006】その際、単にファーフィールドパターンの 長軸方向の光束縁部までを取り込んだのでは、光スポット形状が楕円形状になってしまうので、長軸方向の周辺 部まで光束を取り込むとともに、取り込んだ光束の断面 形状を「円形状に近づけるためのビーム整形」が行われる。

【0007】ビーム整形を行う方法としては、2つのビーム整形プリズムを対に組み合わせる方法や、シリンドリカルレンズを用いる方法が知られているが、これらを用いることにより光ピックアップ装置が大型化する問題がある。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】この発明は、記録・再生波長の異なる2種の光記録媒体に対して記録・再生を行うことができ、良好なビーム整形を行うことができ、なおかつコンパクト化の可能な光ピックアップ装置の実現を課題としている。

【0009】この発明はまた、記録・再生波長の異なる2種の光記録媒体に対して記録・再生を行うことができ、良好なビーム整形を行うことができ、光利用効率が良く、なおかつコンパクト化の可能な光ピックアップ装置の実現を課題としている。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】この発明の光ピックアッ プ装置は「記録・再生の波長が互いに異なる第1種およ び第2種の光記録媒体の何れにも使用可能な光ピックア ップ装置」であって、第1および第2の光源LDと、カ ップリングレンズと、対物レンズと、光路分離光学手段 と、検出手段と、制御手段と、ビーム整形用ホログラム 素子を有する。「第1および第2の光源LD」は、互い に発光波長の異なる2つの半導体レーザである。「カッ プリングレンズ」は、第1および第2の光源LDに共通 に設けられ、各光源LDからの光束をカップリングする レンズである。カップリング作用は、コリメート作用と することもできるし、カップリング後の光束が弱い発散 性の光束もしくは集束性の光束になるようにしてもよ い。「対物レンズ」は、カップリングされた各光束を、 光記録媒体の光記録面に光スポットとして集光させるレ ンズであって、上記各光束に共通に設けられる。「光路 分離光学手段」は、光記録媒体により反射され、対物レ ンズを介して戻り光束となった各光束を、光源LDから 対物レンズに至る照射光路から分離させるための光学手 段である。

【0011】「検出手段」は、光路分離光学手段により分離された各光束を受光して、反射光束の情報を検出する手段である。「反射光束の情報」は、光記録媒体に記録された情報に対する再生用の情報や、フォーカス誤差信号やトラック誤差信号等のサーボ制御用の情報である。「制御手段」は、検出手段の検出結果に基づき、フォーカシング制御およびトラッキング制御を行う手段であり、コンピュータやCPUあるいは制御回路として実現される。「ビーム整形用ホログラム素子」は、第1および/または第2の光源LDからの光束に対し、その楕円強度分布をより円形に近い強度分布に変換するビーム

整形用の光学素子であり、ホログラムとして構成される。ビーム整形用ホログラム素子のビーム整形機能は、上記の如く、各光源LDからの光束に対して作用しても良いが、例えば、記録・再生の光エネルギーや光スポットの円形状性がより必要な方のレーザ光束(一般に短波長のレーザ光束)に就いてのみ、ビーム整形機能が作用するようにすることもできる。第1の光源LDは「第1種の光記録媒体が用いられるとき」にのみ点灯され、第2の光源LDは「第2種の光記録媒体が用いられるとき」にのみ点灯される。

【0012】上記の如く、この発明の光ピックアップ装置は、第1および第2の光源LDに対し「共通の光学系」が用いられる。このように、共通の光学系に対して、2つの光源LDを用い、光記録媒体が第1種のものか第2種のものかに応じて、光源LDを選択的に点灯させるので、各光源LDごとに別個の光学系を設ける場合に比して、光ピックアップ装置をコンパクトに構成することができる。また、ビーム整形用ホログラム素子は、ビーム整形用プリズム対を用いる場合や、シリンドリカルレンズを用いる場合に比してコンパクトであり、また、取付け精度も緩やかである。

【0013】請求項1記載の光ピックアップ装置において、ビーム整形用ホログラム素子として「偏光性ホログラム」を用いることができる。「偏光性ホログラム」は、偏光性回折格子として知られ「格子溝に入射する光の偏光状態により、透過あるいは回折を生じる回折素子」である。このような偏光性ホログラムは、雑誌:OplusE1991年3月号の第86頁以下の「偏光性ホログラム光学素子」に記載された「材料にLiNbO3を用いたもの」や、雑誌:光学第20巻第8号(<math>1991年8月)の500(36)頁以下の「光磁気へッド用高密度デュアルグレーテイング」に記載された「波長の1/2程度の狭いピッチで溝の深い回折格子」等を利用できる。

【0014】請求項1または2記載の光ピックアップ装置は、第1および第2の光源LDからの各光束に対し、所定の位相差を発生させる「位相子」を有することができる(請求項3)。この場合、ビーム整形用ホログラム素子を偏光性ホログラムとし、該偏光性ホログラムを位相子と一体化することができる(請求項4)。

【0015】上記位相子として、一方の光源LDからの 光束に対して「波長の半整数倍(半波長の奇数倍)」の 位相差を生じさせ、他方の光源LDからの光束に対して 「波長の整数倍」の位相差を生じさせるものを用いるこ とができる(請求項5)。この位相子は、一方の光源L Dからの光束に対しては所謂「λ/2板」、他方の光源 LDからの光束に対しては所謂「λ板」として作用する から、一方の光束のみの偏光方向を90度旋回させる光 学機能を持つ。

【0016】上記請求項1~5の任意の1に記載の光ピ

ックアップ装置において、光路分離光学手段を「光路分 離用ホログラム素子」とすることができ(請求項6)、 この光路分離用ホログラム素子も「偏光性ホログラム」 として構成することができる(請求項7)。この場合、 第1および第2の光源LDからの各光束に対し、所定の 位相差を発生させる位相子を複数有することができる (請求項8)。例えば、位相子の一つを前述の「一方の 光源LDからの光束に対して波長の半整数倍の位相差を 生じさせ、他方の光源LDからの光束に対して波長の整 数倍の位相差を生じさせるもの」とし、別の位相子を 「各光源LDからの光束に対して、1/4波長分の位相 差を与えるもの (所謂「λ/4板」)」とすることがで きる。ビーム整形用ホログラム素子と光路分離用ホログ ラム素子をともに「偏光性ホログラム」とする場合、複 数の位相子と各偏光性ホログラムを一体化することがで きる(請求項9)。

【0017】上記請求項3または4または5または8または9記載の光ピックアップ装置において、位相子(複数の位相子を用いる場合には、そのうちの1以上)を「蒸着位相差膜」として構成することができる(請求項10)。

【0018】上記請求項 $1\sim10$ の任意の1に記載の光ピックアップ装置は「第1および第2の光源LDを同ーキャン内に配備する」ことができるが(請求項11)、この場合、第1,第2の光源LDを配備した同ーキャン内に「検出手段の受光部」を配備することができる(請求項12)。

【0019】請求項1~12の任意の1に記載の光ピックアップ装置において、カップリングレンズのカップリング作用を「コリメート作用」とする場合、ホログラム素子(ビーム整形用ホログラム素子および/または光路分離用ホログラム素子)を、「各光源LDからの光束が平行光束となる部分」に配備することができ(請求項13)、あるいは、上記ホログラム素子を「第1および第2の光源LDからカップリングレンズに至る光路上」に配備することもできる(請求項14)。この請求項14記載の光ピックアップ装置においては、第1および第2の光源LDを同一キャン内に配備し、且つホログラム素子を上記キャンに一体化することができる(請求項15)。

【0020】上記請求項1~15の任意の1に記載の光ピックアップ装置は、光軸合わせ光学手段を有することができる(請求項16)。「光軸合わせ光学手段」は、第1の光源LDからの光束の光軸と、第2の光源LDからの光束の光軸とを、各光束のファーフィールドパターンの方向を揃えてカップリングレンズに対して互いに合致させる光学手段である。「各光束のファーフィールドパターンの方向を揃え」るとは、各光束のファーフィールドパターンの長軸方向同士が合致するようにすることを意味する。この請求項16記載の光ピックアップ装置

においても、第1および第2の光源LDを同一キャン内に配備し、上記キャン内に光軸合わせ光学手段を配備することができる(請求項17)。勿論、この場合にも、検出手段の受光部を上記キャン内に配備することができる。

#### [0021]

【発明の実施の形態】図1 (a)において、符号1は第1の光源LD、符号2は第2の光源LDを示している。説明の具体性のため、光源LD1は発光波長:785 nmの半導体レーザで、光源LD2は発光波長:650 nmの半導体レーザであるとする。半導体レーザには「レーザ個体ごとの波長ばらつき」や「温度による波長変化」があるので、実際の発光波長は、上記波長を略中心値とする±20 nm程度の波長範囲のものとなる。

【0022】符号9は第2種の光記録媒体としての、基板厚さ:0.6mmの「大容量の光ディスク」を示し、符号10は第1種の光記録媒体としての、基板厚さ:1.2mmの「低容量の光ディスク」を示している。これらは本来「別体」であり、別個に用いられるが、説明の都合上一つにまとめて描いてある。

【0023】第1種の光記録媒体である低容量の光ディスク10に対して、記録または再生(あるいは消去)が行われるときは光源LD1が点灯される。光源LD1からのレーザ光束はカップリングレンズ3、ビーム整形用ホログラム素子4、ビームスプリッタ5を透過し、偏向プリズム7に反射されて対物レンズ8に入射し、対物レンズ8の作用により集光光束と成り、光ディスク10の基板を透過し、記録面に光スポットとして集光する。記録面で反射された光は対物レンズ8を透過して「戻り光束」となり、偏向プリズム7に反射されてビームスプリッタ5により反射され、集光レンズ11とシリンダレンズ12とを透過し、受光手段13に入射する。

【0024】第2種の光記録媒体である大容量の光ディスク9に対して記録または再生(あるいは消去)が行われるときは、光源LD2が点灯され、放射されたレーザ光束はカップリングレンズ3、ビーム整形用ホログラム素子4を透過し、ビームスプリッタ5、偏向プリズム7に反射され、対物レンズ8を介して光ディスク9の基板を透過し、記録面に光スポットとして集光する。記録面で反射された光は、対物レンズ8を透過して「戻り光束」となり、偏向プリズム7およびビームスプリッタ5により相次いで反射され、集光レンズ11とシリンドリカルレンズ12を介して受光手段13に入射する。

【0025】光ディスク10が用いられるときも、光ディスク9が用いられるときも、戻り光束はビームスプリッタ5により反射されると集光レンズ11により集束され、さらにシリンドリカルレンズ12により非点収差を与えられ、受光手段13に入射する。受光手段13では、公知の「非点収差法」によるフォーカス誤差信号と「位相差法」によるトラック誤差信号とが発生し、サー

ボ制御系(マイクロコンピュータやCPU等)16はこ れら信号に基づき、フォーカシング制御とトラッキング 制御を行う。受光手段13は「再生信号」も出力する。 即ち、ビームスプリッタ5は、光源LD1、2からの各 光束に共通の「光路分離光学手段」を構成し、集光レン ズ11とシリンドリカルレンズ12と受光部13とは上 記各光束に共通の「検出手段」を構成し、サーボ制御系 16は「制御手段」を構成する。なお、集光レンズ11 とシリンドリカルレンズ12とに代えて「片面が凸の球 面で、他方の面が凸のシリンダ面であるような単一のレ ンズ」を用いることもできる。また、フォーカシング制 御は、上記非点収差法に代えて公知のナイフエッジ法等 の他の方式でもよく、トラッキング制御も、プッシュプ ル法等、公知の適宜の方法を利用でき、これらフォーカ シング制御やトラッキング制御の具体的方法に応じて 「検出手段」を適宜に構成できる。

【0026】図1 (a) において、光源LD1, 2から の光束は、光ディスクへ向かう途上でビームスプリッタ 5により反射され、集光レンズ14により受光手段15 に集光される。受光手段15は「出力モニタ」用で、受 光手段15の出力に基づき光源LDの出力制御が行われ る。光源LD1,2の出力制御を、これら光源LDの 「後方出力」をモニタしながら行う場合には、集光レン ズ14と受光手段15とは不用である。しかし、図1 (a) のように集光レンズ14と受光手段15とを用い て出力制御を行うようにすれば、戻り光束(図1(a) の光学配置では、戻り光束の一部が光源LD1, 2に戻 る) に影響されずに良好な出力制御を行うことができ る。なお、図1 (a) においては図の繁雑を避けるた め、レンズによる屈折による光線の屈曲等を無視し、各 光源LDからの光を直線として描いた。また、カップリ ングレンズ3のカップリング作用は、光源LD1,2か らの各光束に対して「コリメート作用」である。

【0027】図1(b)に示すように、光源LD1,2 から放射されるレーザ光束は「発散光束」であるが、活 性層1Aに平行な方向をX方向、活性層1Aに直交する 方向をY方向とすると、周知の如く、放射レーザ光束の ファーフィールドパターンFFは「楕円形状」で、その 長手方向はY方向に平行になる。一方、光源LD1,2 から放射されるレーザ光束の「偏光方向」はレーザ光束 中における電場の振動方向であり、この振動方向はX方 向に平行な場合と、Y方向に平行な場合とがある。一般 に知られた半導体レーザでは「偏光方向はX軸に平行」 であり、これは電場の振動方向が活性層1Aに平行であ ることから「TE発光モード」と呼ばれている。一方 「偏光方向がY方向に平行な場合」は、レーザ光束中の 磁場の振動方向が活性層1Aと平行になるので「TM発 光モード」と呼ばれている。TM方向モードで発光する 半導体レーザ光源は、現在、発光波長:635nmのも のが知られている。

【0028】さて、図1(a)の実施の形態におけるビ ーム整形用ホログラム素子4は、以下の如き、光学作用 を有する。光源LD1, 2から放射される光束のファー フィールドパターンの長軸方向を図1(b)に示すよう にY方向、短軸方向をX方向とすると、光源LD1,2 から放射された発散性の光束は、カップリングレンズ3 によりカップリングされると、平行光束になる。カップ リングレンズ3は、光源LD1, 2からの光束の、実質 的に全てをカップリングし、従って、カップリングされ た光束は、その強度分布が「ファーフィールドパターン に応じた楕円形状」になる。従って、この楕円形状の長 手方向はY方向に合致し、短軸方向はX軸方向に合致す る。平行光束化された光束は、ビーム整形用ホログラム 素子3に入射する。図1 (c) に示すように、ビーム整 形用ホログラム素子3は「Y方向に関しては入射平行光 束をそのまま透過」させる。従って、ビーム整形用ホロ グラム3の前後で、ある強度を示す光束径:D, はY方 向においては変化しない。一方、X方向に関しては、ビ ーム整形ホログラム4は、ある強度を示す光束径を、入 射時の光束径: Dxlから射出時の光束径: Dx2へ拡大さ せる機能を有する。半導体レーザから放射されるレーザ 光束の、最小発散角:最大発散角は1:2~1:4程度 で光源LDの種類に応じて定まる。従って、カップリン グレンズ3によりカップリングされた平行光束における 光束断面の楕円形状(長軸径:短軸径)は、光源LD1 と光源LD2とで必ずしも同じでない。そこで、ビーム 整形用ホログラム素子4の作用は、光源LD1, 2から の各光束に対し、上記光束径: D, とDx2とが「略等し くなるように」設定される。即ち、ビーム整形用ホログ ラム素子3は「第1および第2の光源LD1, 2からの 各光束に対し、その楕円強度分布をより円形に近い強度 分布に変換する」ビーム整形機能を有する。このビーム 整形機能により、ビーム整形用ホログラム素子4を透過 した各光束は強度分布が「略円形状」となるから、光デ ィスクの記録面に略円形状の光スポットとして集光させ ることができ、高い記録再生能力を実現することができ る。ビーム整形用ホログラム素子4は、その設置が、プ リズム対やシリンドリカルレンズといった従来の「ビー ム整形用光学素子」を用いる場合に比して設置スペース を取らず、設置態位の調整も容易であり、これを用いる ことにより、光ピックアップ装置のコンパクト化が可能 になる。なお、光源LD1、2の発光波長が異なること により、カップリングレンズ3の色収差の影響が考えら れるが、実用上の問題と成るほどの影響ではない。所望 により、カップリングレンズ3を、アッベ数の異なる2 枚のレンズの「接合レンズ」として構成することにより 色収差を補正することも可能である。

【0029】図1(a)に実施の形態を示した光ピックアップ装置は「記録・再生の波長が互いに異なる第1種および第2種の光記録媒体10,9の何れにも使用可能

な光ピックアップ装置であって、互いに発光波長の異な る第1および第2の光源LD1,2と、これら第1およ び第2の光源LD1, 2に共通に設けられ、各光源LD からの光束をカップリングするカップリングレンズ3 と、カップリングされた各光束を、光記録媒体9,10 の光記録面に光スポットとして集光させる、上記各光束 に共通の対物レンズ8と、光記録媒体9,10により反 射され、対物レンズ8を介して戻り光束となった各光束 を光源LD1, 2から対物レンズ8に至る照射光路から 分離させる、各光束に共通の光路分離光学手段5と、光 路分離光学手段5により分離された各光束を受光して反 射光束の情報を検出する、各光束に共通の検出手段1 1,12,13と、該検出手段の検出結果に基づきフォ ーカシング制御およびトラッキング制御を行う制御手段 16と、第1および第2の光源LDからの各光束に対 し、その楕円強度分布をより円形に近い強度分布に変換 するビーム整形用ホログラム素子4を有し、第1の光源 LD1は、第1種の光記録媒体10が用いられるときに のみ点灯され、第2の光源LD2は、第2種の光記録媒 体9が用いられるときにのみ点灯される光ピックアップ 装置」である(請求項1)。

【0030】図1 (a) に示した実施の形態において は、光路分離光学手段としてビームスプリッタ5を用い たので、光の利用効率は必ずしも高いと言えない。図2 は、光利用効率を高めた実施の形態を示している。繁雑 を避けるため、混同の虞れがないと思われるものに就い ては図1におけると同一の符号を付した。図1(a)の 実施の形態と異なる点は、光路分離光学手段として偏光 ビームスプリッタ5Aと位相子6が用いられている点で ある。光源LD1または2から放射されたレーザ光東は カップリングレンズ3により平行光束に変換され、ビー ム整形用ホログラム素子4により「ビーム整形」されて 偏光ビームスプリッタ5Aに入射する。光源LD1, 2 は「発光モードが同じもの」であり、放射されるレーザ 光束の偏光方向は図面に平行な面内にある。この偏光方 向は偏光ビームスプリッタ5Aの偏光分離膜に対しては P偏光であり、従って、光源側からのレーザ光束は偏光 ビームスプリッタ5Aを透過する。偏光ビームスプリッ タ5Aを透過した光束は位相子6を透過し、その際、偏 光状態を直線偏光状態から円偏光状態に変換される。そ して、光束は偏向プリズム7により偏向され、対物レン ズ8の集束作用により光ディスク9 (光源LD2が点灯 されるとき)または光ディスク10(光源LD1が点灯 されるとき)の記録面に光スポットとして集光する。記 録面による反射光束は対物レンズ8を透過して「戻り光 束」となり、偏向プリズム7により反射され、位相子6 を透過することにより、往路とは直交する方向の直線偏 光状態に戻されて偏光ビームスプリッタ5Aに入射す る。この時の偏光方向は偏光分離膜に対してS偏光であ るので、光束は偏光ビームスプリッタ5Aにより反射さ

れ、集光レンズ11、シリンドリカルレンズ12を介して受光部13に入射する。

【0031】このような構成にすると、偏光ビームスプリッタ5AはP偏光の実質100%を透過させ、S偏光の実質100%を反射するので光の利用効率は高い。特に、ビーム整形用ホログラム素子4によりビーム整形を行い、光源LDからの光束の実質的に全てを記録・再生・消去に利用できるので、光の利用効率は極めて高くなる。この場合、偏光ビームスプリッタ5Aによってはモニタ用の光束を分離できないので、各光源LDに対する出力制御は後方出力をモニタしながら行うことになる。

【0032】位相子6は、光源LD1, 2からの互いに 波長の異なる光束のいずれに対しても1/4波長板(所 謂「 $\lambda/4$ 板」)として作用するが、このような位相子 は以下のようにして、実現できる。位相子6を構成する「複屈折性材料」における常光線と異常光線に対する屈 折率を、波長: $\lambda_1$ (説明中の例では785nm)に対して: $N_{01}$ 、 $N_{E1}$ 、波長: $\lambda_2$ (説明中の例では650 nm)に対して $N_{02}$ 、 $N_{E2}$ とし、複屈折性材料の機械的 な厚さをdとすれば、波長: $\lambda_1$ 、 $\lambda_2$ に対し、複屈折性 材料を透過したときの常光線と異常光線の位相差: $\delta$ ( $\lambda_1$ )、 $\delta$ ( $\lambda_2$ )は、

 $\delta (\lambda_1) = (2 \pi/\lambda_1) (N_{01} - N_{E1}) d$ ,  $\delta (\lambda_2) = (2 \pi/\lambda_2) (N_{02} - N_{E2}) d$ 

であるから、上記複屈折性材料の層が、各波長の光に対して $\lambda/4$ 板として作用するためには、n, Nを自然数として、

 $\delta(\lambda_1)$  =  $(2n+1)\delta(\lambda_2)$  =  $(2N+1)(\pi/2)$  が満足されるように、上記厚さ:d を決定すればよい。 複屈折性材料としては水晶、ニオブ酸リチウム(LiN  $bO_3$ )等を利用できるが、フッ化マグネシウム(Mg  $F_2$ )等を材料として「蒸着位相差膜」として形成することができる(請求項10)。従って、図2に実施の形態を示す光ピックアップ装置は、第1および第2の光源 LD1, 2 からの各光束に対し、所定の位相差(1/4 波長分の位相差)を発生させる位相子6を有する(請求項3)。

【0033】図2の実施の形態においては、光源LD 1,2は、同じ発光モードのものが用いられている。2つの光源LD1,2は、互いに異なる発光モードのものを用いることもできる。図3に示す実施の形態は、このような場合の例である。光源LD1としては、発光波長:785nmのTE発光モードのものが用いられ、光源LD2としては、発光波長:635nmのTM発光モードのものが用いられている。この場合、大容量光ディスク10は波長:635nmに応じたものとなることは言うまでもない。

【0034】TE発光モードとTM発光モードとでは、ファーフィールドパターンの長軸方向に対する偏光方向が異なる。即ち、図1(b)に即して説明したように、

ファーフィールドパターンFFの長軸方向をY方向とし たとき、偏光方向は、TE発光モードではX方向、TM 発光モードではY方向である。従って、ファーフィール ドパターンの長軸方向を、例えば、図3で図面に直交す る方向に向ければ、TM発光モードで発光する発光LD 2からのレーザ光束は、偏光ビームスプリッタ5Aの偏 光分離膜に対してS偏光となるので、偏光ビームスプリ ッタ5Aに入射する以前に、光源LD2からの光束の偏 光方向を90度旋回させる必要がある。図3の実施の形 態においてこれを行うのは、ビーム整形用ホログラム素 子4に一体化された位相子6日である。位相子6日は、 光源LD1からの光束に対しては「波長の整数倍の位相 差」を生じさせ、光源LD2からの光束に対しては「波 長の半整数倍の位相差」を生じさせる。このような光学 作用により、位相子6Bを透過するとき、光源LD2か らの光束のみが、偏光方向を90度旋回されて、偏光ビ ームスプリッタ5Aを透過できるようになる。ビーム整 形用ホログラム4以降の作用は、図2の実施の形態の場 合と同様である。

【0035】即ち、図3に実施の形態を示す光ピックアップ装置は、第1および第2の光源LD1,2からの各光束に対し、所定の位相差を発生させる2つの位相子6,6Bを有するものであり(請求項4,8)、位相子6Bは、一方の光源LDからの光束に対して波長の半整数倍の位相差を生じさせ、他方の光源LDからの光束に対して波長の整数倍の位相差を生じさせるものである(請求項5)。

【0036】また、図1、図2、図3に即して説明した 実施の各形態において用いられているビーム整形用ホロ グラム素子4は、通常のホログラム素子でも良いが、こ れを前述の「偏光性ホログラム」としてもよい。上記実 施の各形態において、このようにしたものは請求項2記 載の発明の実施の形態となる。また、図3に示す実施の 形態で、ビーム整形用ホログラム素子4を偏光性ホログ ラムとしたものは、請求項4記載の発明の実施の形態と なる。

【0037】図3の実施の形態における位相子6 Bは、光源LD1からの光束に対しては偏光方向を保ったまま 透過させ、光源LD2からの光束に対しては「 $\lambda/2$  板」として作用する。このような位相子は以下のようにして、実現できる。位相子6 Bを構成する「複屈折性材料」における常光線と異常光線に対する屈折率を、波長: $\lambda_1$  (説明中の例では785 nm)に対して:  $N_{01}$ ,  $N_{E1}$ 、波長: $\lambda_2$  (説明中の例では635 nm)に対して $N_{02}$ ,  $N_{E2}$ とし、複屈折性材料の機械的な厚さを dとすれば、波長: $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ に対し、複屈折性材料を 透過したときの常光線と異常光線の位相差: $\delta(\lambda_1)$ ,  $\delta(\lambda_2)$ は、

 $\delta (\lambda_1) = (2 \pi/\lambda_1) (N_{01} - N_{E1}) d, \delta (\lambda_2) = (2 \pi/\lambda_2) (N_{02} - N_{E2}) d$ 

であるから、上記複屈折性材料の層が波長:785nm の光に対して「 $\lambda$  板」として作用し、波長:635nm の光に対して「 $\lambda$   $\angle$  2 板」として作用する条件は、n, Nを自然数として、

 $\delta (\lambda_1) = 2\,\mathrm{N}\,\pi$ ,  $\delta (\lambda_2) = (2\,\mathrm{n}+1)\,\pi$  を満足するように厚さ「 $\mathrm{d}$ 」を設定すればよい。複屈折性材料としては水晶、ニオブ酸リチウム( $\mathrm{L}$  i N b  $\mathrm{O}_3$ )等を用いることができ、また前記フッ化マグネシウムを複屈折性材料として「蒸着位相差膜」として形成することができ(請求項10)。図3における位相子6 Bはこのような例になっている。なお、図3に示す実施の形態において、位相子6 Bの作用を光源LD1からの光束に対して「 $\lambda$ /2板」、光源LD2からの光束に対して「 $\lambda$ /2板」、光源LD2からの光束に対して「 $\lambda$ /8板」となるように構成することも勿論可能である。

【0038】図4の実施の形態は、ビーム整形用ホログ ラム素子4Aとして「偏光性ホログラム」を用い(請求 項2)、光路分離光学手段として「偏光性ホログラム」 による光路分離用ホログラム素子5Bを用い(請求項 6,7)、各光源LD1,2からの光束に対し、所定の 位相差(90度の奇数倍)を発生させる位相子6Aを有 する点に特徴がある。偏光性ホログラムは、前述したよ うに、入射光束の偏光状態により光学作用が異なる。図 4 (a) における光源LD1, 2が同じ発光モードのも ので、各レーザ光束の偏光方向が図面に平行な面内にあ るものとすると、偏光性ホログラムによるビーム整形用 ホログラム素子4Aは、上記図面に平行な方向に偏光し た光束に対してビーム整形用ホログラムとして作用する が、図面に直交する方向に偏光した光束に対してはホロ グラムとして機能せず、このような光束は「そのまま透 過」させる。これに対し、偏光性ホログラムとして構成 された光路分離用ホログラム素子5Aは、図面に平行な 面に偏光している光束をそのまま透過させ、図面に直交 する方向に偏光した光束に対してホログラムによる回折 作用を作用させる。

【0039】光源LD1または2からのレーザ光束は従って、カップリングレンズ3により平行光束化されると、ビーム整形用ホログラム素子4Aの作用によりビーム整形され、光路分離用ホログラム素子5Bを透過し、位相子6A(光源LD1,2からの各光束に対して「1人をして作用する」により円偏光状態になり、偏向プリズム7と対物レンズ8を介して光ディスク9または10に照射される。戻り光束は、位相子6Aを透過した光束と成り、光路分離用ホログラム素子5Bのホログラム作用(回折作用)を受け、受光部13Aに向かって偏向され、カップリングレンズ3の作用により受光部13A上に集光する。偏光性ホログラムによる光路分離用ホログラム素子5Bは、図4(b)に示すように、回折作用の異なる3つのホログラム部分51.5

2,53を有し、ホログラム部分51に入射した戻り光 東部分は、図4 (c) に示す受光手段13Aの2分割受 光部13A1に入射し、ホログラム部分52,53に入 射した戻り光束部分は、それぞれ受光部分13A2,1 3A3に入射する。これら入射光束は、カップリングレ ンズ3の作用により上記各受光部分に向かって集光す る。光路分離用ホログラム素子5Bのホログラム部分5 1とホログラム部分52,53との「直線状の境界部」 は、ナイフエッジ法によるフォーカシング制御のための 「ナイフエッジ」として機能し、フォーカシング制御の ためのフォーカス誤差信号は2分割受光部分13A1の 各受光部からの出力の差として構成される。また、トラ ッキング制御のためのトラック誤差信号は、受光部分1 3A2, 13A3の出力の差として構成することができ る。勿論、再生信号は受光部分13A1,13A2,1 3A3の出力和(もしくはその一部)として得られる。 図4(a)に示す実施の形態においては、光源LD1, 2が同じ発光モードのものであるが、光源LD1, 2の 一方にTE発光モード、他方にTM発光モードのものを 用いる場合には、図4 (d)に示すように、光源LD 1, 2からのレーザ光束における偏光方向が、ビーム整 形用ホログラム素子4 Aの手前で同一方向になるよう に、一方の光束に対して「λ板」、他方の光束に対して 「λ/2板」として作用する位相子6 Bを、ビーム整形 用ホログラム素子4Aの光源側に配備すればよい。ある いは、図4(e)に示すように、位相子6B、ビーム整 形用ホログラム素子4A、光路分離用ホログラム素子5 B、位相子6Aを一体化してもよい。

【0040】即ち、図4(d), (e)の形態は、ビーム整形用ホログラム素子4Aと光路分離用ホログラム素子5Bがともに、偏光性ホログラムであって、複数の位相子6A,6Bと、各偏光性ホログラムが一体化されている(請求項8)。

【0041】図1~図4に即して上に説明した実施の各形態においてカップリングレンズ3のカップリング作用は、第1および第2の光源LD1,2からの光束を「コリメートする機能」を有し、ホログラム素子は、各光源LD1,2からの光束が平行光束となる部分に配備されている(請求項13)。この発明におけるビーム整形用ホログラム素子のビーム整形機能は「第1および第2の光源LDからの各光束に対し、その楕円強度分布をより円形に近い強度分布に変換する」ことであるから、ビーム整形用ホログラム素子を配備する位置において、各光束は必ずしも平行光束状態である必要はない。光路分離用ホログラム素子の配備位置も同様である。

【0042】図5に示す実施の形態は、請求項14記載の発明の光ピックアップ装置の実施の1形態を示している。この実施の形態においては、ビーム整形用ホログラム素子4a、光路分離用ホログラム素子5b等のホログラム素子(偏光性ホログラムである)が互いに一体化さ

れ、第1および第2の光源LD1, 2からカップリングレンズ3に至る光路上に配備されることを特徴とする。またこれらは、各光源LDからの光束に対して「 $\lambda/4$  板」として作用する位相子 6 a と一体化されている。位相子 6 a は「蒸着位相差膜」として光路分離用ホログラム素子 5 b に一体化されている。この実施の形態においては、光源LD1または2からのレーザ光束は、発散しつつビーム整形用ホログラム素子 4 a に入射してビーム整形されるが、このときのビーム整形機能は、図1

(b) に示すファーフィールドパターンFFの短軸方向 (X方向) の発散角を増大させて、長軸方向 (Y方向) の発散角に近付けるような機能である。このビーム整形機能によりビーム整形された各光束は「より円形に近い強度分布」に変換され、光ディスクの記録面上に「円形状もしくはこれに近い楕円形状」の光スポットとして集光される。戻り光束は、カップリングレンズ3を透過すると集光性の光束と成って位相子6aを透過し、往路とは90度異なる直線偏光状態に戻り、光路分離用ホログラム素子5bの回折作用により光路分離され、ビーム整形用ホログラム素子4aの回折作用を受けること無くこれを透過し、受光部13aに向かって集光する。

【0043】図5のような実施の形態では、戻り光束の光路分離が「光源LDの近傍」で行われるので、受光部13aと光源LD1,2とを近接させて配備できる。光路分離用ホログラム素子5b及び受光部13aは、図4(b),(c)に即して説明したものと同様のものである。なお、光源LD1,2の発光モードが互いに異なる(一方がTE発光モード、他方がTM発光モード)場合には、ビーム整形ホログラム素子4aの光源側に、一方の光源LDからの光束に対して「λ/2板」として作用する(前記位相子6Bと同様の)位相子を配備すればよい。勿論、この位相子は蒸着位相差膜としてビーム整形ホログラム素子4aに蒸着形成することができる。

【0044】図1~図5に示した実施の形態において、 作図の関係で、光源LD1, 2の間隔を誇張して描いた が、実際には、光源LD1, 2は互いに近接して配備さ れるものであり、図6(a)に示すように、同一キャン CN内に配備することが可能である(請求項11)。図 6 (a) に示す如き光源は、図1~図5に即して説明し た任意の実施の形態の光源として用いることができる。 図6(b)は、同一キャンCN内に、第1および第2の 光源LD1, 2とともに、検出手段における受光部13 0を配備した例(請求項12)を示している。このよう に受光部130と光源LD1,2とを同一キャンCN内 に配備したものは、図4または図5の実施の形態におけ る光源・受光部として使用できる。図6 (c)は、図5 に示した実施の形態において、光源LD1,2と受光部 13aとを同一キャンCN内に配備するとともに、キャ ンCNにホログラム素子(ビーム整形用ホログラム素子 4 a、光路分離用ホログラム素子5 b) および位相子6 aを一体化した例 (請求項15) を示している。このようにすることにより請求項14記載の発明の光ピックアップ装置 (図5参照) を極めてコンパクトに構成することが可能である。

【0045】図1~図6に即して説明した実施の形態においては、光源LD1,2からの放射されるレーザ光束の光束光軸が互いに合致していないので、光源LD1,2の何れが点灯されるかに応じて「戻り光束が検出手段の受光部に入射する位置」が若干異なるので、「予め、フォーカス誤差信号・トラック誤差信号に、戻り光束の入射位置のずれに応じたオフセットを与え」たり、「戻り光束ごとに受光部を1組づつ設け」たり、「光源LD1,2のいずれが点灯されるかに応じ、検出手段の受光部の位置を調整して、戻り光束を受光手段11の適切な位置に入射させる」等の工夫が必要である。このような面倒を回避するには、請求項16記載の発明のように

「第1の光源LD1からの光東の光軸と、第2の光源LD2からの光東の光軸とを、各光東のファーフィールドパターンの方向を揃えて、カップリングレンズに対して互いに合致させる光軸合わせ光学手段」を設ければよい。このような「光軸合わせ光学手段」は、種々の光学装置において様々な手段が公知であり、これら公知のものを適宜利用することができる。以下、具体的な例を4例挙げる。

【0046】図7(a)は、光源LD1,2からのレーザ光束を「光軸合わせ光学手段」である合成プリズム120を用いて光軸合わせする例である。合成プリズム120が有する分離膜121は、光源LD1からのレーザ光束を実質的に全て透過させ、光源LD2からのレーザ光束を実質的にすべて反射する性質を有する。

【0047】このような性質を有する分離膜121としては、種々のものが考えられる。先ず第1に、光源LD1と光源LD2とでは「発光波長が異なる」ことを考慮すると、分離膜121として公知の「ダイクロイックフィルタ膜」を利用することが考えられる。例えば、光源LD1の発光波長が「785nm」で、光源LD2の発光波長が「650nm」であるとすれば、ダイクロイックフィルタ膜の光学特性を、波長:785nmの光を透過させ、波長:650nmの光を反射させるように設定すればよい。

【0048】第2に、分離膜121として「偏光分離膜」を用いることが考えられれる。この場合、合成プリズム120は、偏光ビームスプリッタになる。例えば、光源LD1としてTE発光モードのものを用い、レーザ光束が「図面に平行な面内で偏光する」ように配備し、光源LD2してはTM発光モードのものを用い、レーザ光束が「図面に直交する方向に偏光する」ように配備すれば、光源LD1からのレーザ光束は分離膜121を透過し、光源LD2からのレーザ光束は分離膜121に反

射されるので、各光源LDからのレーザ光束の光束光軸を「ファーフィールドパターンの方向を揃えて(この場合、ファーフィールドパターンの長軸方向が図面に直交する方向になる)」、カップリングレンズ以下の光学系の光軸に合致させることができる。

【0049】図7(b)は、光軸合わせ光学手段の第3 例として、光源LD1, 2として、同じ発光モード(例 えばTE発光モード)のものを用いる場合の、実施の1 形態を示している。光軸合わせ光学手段は、偏光ビーム スプリッタ120Aと位相子14a1とを一体化してな る。光源LD1、2を、そのファーフィールドパターン の短軸方向が図面に直交するように配備すると、光源L D1, 2からのレーザ光束は、いずれも図面に直交する 方向の偏光方向を有するので、光源LD1からのレーザ 光束の偏光方向を「1/2板」として機能する位相子1 4a1により90度旋回させる。このようにして、光源 LD1からのレーザ光束は偏光分離膜121Aを透過 し、光源LDからのレーザ光束は偏光分離膜121Aに より反射される。このようにして、各光源LDからの各 光束を、ファーフィールドパターンの方向を揃えて、カ ップリングレンズ以下の光学系の光軸に合致させること ができる。

【0050】光軸合わせ光学手段の第4例として、図7 (a) における合成プリズム120における分離膜12 1が、図7(c)に示す如き「波長偏光フィルタ特性」 を持つものを用い場合を挙げることができる。この波長 偏光フィルタ特性をS偏光に就いてみると、光源LD 1, 2の発光波長を、それぞれ785nmおよび650 nmとすると、これらレーザ光束をS偏光として分離膜 に入射させた場合、光源LD1からのレーザ光束(波 長:785nm) は実質的に100%反射され、光源し D2からのレーザ光束 (波長:650nm) は実質的に 100%透過する。そこで、図7(a)における合成プ リズム120として、上記波長偏光フィルタ特性を有す るものを用い、図7 (a) における光源LD1, 2の位 置を入れ替え、これらからのレーザ光束が上記波長偏光 フィルタ特性を持つ分離膜121に対して共にS偏光と なるようにすれば(これは、同一の発光モードの各光源 LDのファーフィールドパターンの長軸方向を平行にす ることに対応する)、各光源LDからの光束を、ファー フィールドパターンの方向を揃えて、カップリングレン ズ以下の光学系の光軸に合致させることができる。光源 LD1, 2からの光束を光軸合わせする方法は、上記4 例に限らず、公知の適宜のものを利用できる。

【0051】図7に説明した光軸合わせ光学手段は、図 $1\sim$ 図5に示す任意の実施の形態に適用可能である。図8は、請求項17記載の発明の実施の1形態を説明に必要な部分のみ示している。第1および第2の光源LD1, 2は同一のキャンCN1内に配備され、上記キャンCN1内に、図7(a) に即して説明した「光軸合わせ

光学手段」である合成プリズム120を配備している。このような1パッケージに構成した光源は、図1~図5の実施の形態における光源部として使用できる。また、キャンCN1内に、光源LD1、2と光軸合わせ光学手段121とともに、検知手段の受光部を配備してもよく、このように構成した場合は、図4,5の実施の形態における光源・受光部として使用でき、この場合に、キャンCN1に、図6(c)の場合のように、ホログラム素子および位相子を一体化してもよい。勿論「他の光軸合わせ光学手段」をキャン内に配備してもよい。

#### [0052]

【発明の効果】以上に説明したように、この発明によれば新規な光ピックアップ装置を実現できる(請求項1~17)。この発明の光ピックアップ装置はビーム整形用ホログラム素子により、第1および/または第2の光源しりからの光束に対し、その楕円強度分布をより円形に近い強度分布に変換するので、光源しりに対する光利用効率を高めることができる。また、ビーム整形用ホログラム素子はビーム整形プリズム対やシリンドリカルレンズを用いる場合に比して小型であり、組み就けも容易である。

【0053】請求項2記載の発明では、ビーム整形用ホ ログラム素子として「偏光性ホログラム」を用いること によりホログラム自体の光利用効率を高めることができ る。また、光源LDの偏光方向を変化させることによ り、光源LDに対して、選択的にビーム整形作用を作用 させることもできる。即ち、ビーム整形を必要とされる レーザ光束のみをビーム整形することもできる。請求項 3, 4, 5, 7, 8記載の発明のように位相子を用いる ことにより、戻り光束を偏光状態に従って光路分離で き、検出手段の受光する受光量を増大させて、戻り光束 の情報を高S/N比で検出できる。請求項4,9記載の 発明のように、ホログラム素子と位相子を一体化するこ とにより、光ピックアップ装置のコンパクト化を促進で き、また、独立部品点数が減少し、部品間の相対的な位 置変動が減少するので光ピックアップ装置の信頼性が向 上する。

【0054】請求項6,7記載の発明のように、光路分離光学手段をホログラム素子とすることにより、検出手段を光源と同じ側に配備でき、光ピックアップ装置を小型化できる。また光路分離用ホログラム素子にナイフエッジ等の機能を持たせることにより、サーボ信号(フォーカス誤差信号・トラック誤差信号)発生用の素子が不用になるため検出手段を簡素化でき、光ピックアップ装置を一段とコンパクト化できる。

【0055】請求項10記載の発明のように、位相子を「蒸着位相差膜」として構成することにより、位相子を薄くでき、位相子の材料としての高価な複屈折結晶を用いる必要がなく、光ピックアップ装置の小型化・低コスト化を計ることができる。

【0056】請求項11,12記載の発明のように、第 1および第2の光源LDとともに他の要素を同一のキャン内に一体化することにより、部品点数の削減・一体化 した部品間の変動防止による信頼性の向上を図ることが できる。

【0057】請求項13記載の発明のように、ホログラ ム素子が各光源LDからの光束が平行光束となる部分に 配備されるようにすると、ホログラム素子の配置位置を 光束光軸方向に適宜に設定できるので、ホログラム素子 の配置自由度が増大する。請求項14記載の発明のよう に、ホログラム素子を、第1および第2の光源し口から カップリングレンズに至る光路上に配備することにより 光ピックアップ装置を有効にコンパクト化できる。請求 項15記載の発明のように、第1および第2の光源LD を同一キャン内に配備し、且つホログラム素子を上記キ ャンに一体化することにより、光ピックアップ装置の更 なるコンパクト化が可能になる。請求項16記載の発明 のように、2つの光源LDからの光束の光軸合わせを行 うと、戻り光束と検出手段の位置関係が光源によらず同 一となるので、検出手段による検出が簡単化される。ま た、カップリングレンズ、対物レンズに対し、各光束が 画角を持たずに入射するので、これらレンズによる波面 の劣化を最小限に抑えられ、良好な光スポットを得るこ とができる。請求項17記載の発明のように、第1およ び第2の光源LDを同一キャン内に配備し、上記キャン 内に光軸合わせ光学手段を配備することにより、部品点 数の削減・一体化した部品間の変動防止による信頼性の 向上を図ることができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の光ピックアップ装置の実施の1形態を説明するための図である。

【図2】この発明の光ピックアップ装置の実施の別の形態を説明するための図である。

【図3】この発明の光ピックアップ装置の実施の他の形態を説明するための図である。

【図4】この発明の光ピックアップ装置の実施の他の形態を説明するための図である。

【図5】この発明の光ピックアップ装置の実施の他の形態を説明するための図である。

【図6】請求項11,12,15記載の発明の実施の各 形態を特徴部分のみ示す図である。

【図7】請求項16記載の発明の光軸合わせ光学手段を4例説明するための図である。

【図8】請求項17記載の発明の実施の1形態を特徴部分のみ示す図である。

#### 【符号の説明】

1, 2 光源LD

3 カップリングレンズ

4 ビーム整形ホログラム素子

5 ビームスプリッタ

8 対物レンズ

9,10 光ディスク (光記録媒体)

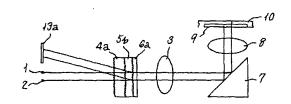
10 集光レンズ

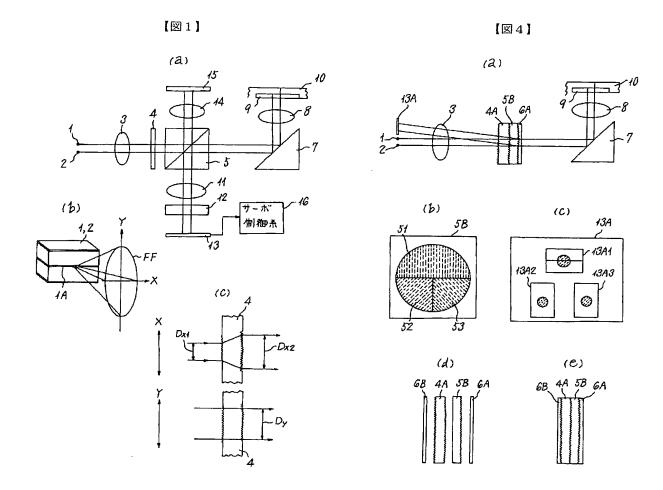
12 シリンドリカルレンズ

13 受光部

[図2] (図3] (図3] (図8]

【図5】

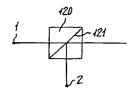




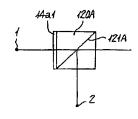
【図6】

【図7】

(a)



(6)



(C)

